

Adriaacuten M. Aguirre, Carlos A. Meacutendez, Pedro M. Castro

A novel optimization method to automated wet-etch station scheduling in semiconductor manufacturing systems.

Almut Metz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Bertelsmann Forschungs-gruppe Politik am Centrum für angewandte Politikforschung (C·A·P). Kristina Notz ist Forschungsassistentin in der Bertelsmann Forschungsgruppe Politik am Centrum für angewandte Politikforschung (C·A·P).
